



全自動多目的 X 線回折装置



装置概要

本装置は、結晶性試料に X 線を照射して回折パターンを得、その回折パターンを解析することで材料の結晶構造の同定や特性評価を行うことができます。

測定対象

粉末・薄膜・バルク・フィルムなど

測定内容例

- ・ 定性分析、構造評価（集中法BB、平行ビーム法PB）
- ・ 多結晶薄膜試料の定性分析（平行ビーム法PB）
- ・ 微小領域の測定（マッピング測定）
- ・ 薄膜試料の膜厚・膜構造評価（反射率測定）
- ・ 薄膜、バルク単結晶試料の結晶性評価（ロッキングカーブ、逆格子マップ）
- ・ バルク、薄膜試料の配向評価（極点測定）
- ・ ナノ材料の粒径、空孔径、長周期構造の評価

利用料金

※機構内 1時間当たり

直接	¥1,300
依頼	¥2,600

利用可能時間

平日	9:00 ~ 17:00
----	--------------

設置場所

工学部 8号館 南棟104号室
（超強力エックス線回折実験室）

利用条件

- ・ 放射線業務従事者第3種または第1種資格を有し、測定時にはルミネスバッジの着用が必要です
- ・ 講習会受講と利用者登録が必要です

全学技術センター 分析・物質技術支援室

日影 達夫 ☒ hikage@etech.engg.nagoya-u.ac.jp
神野 貴昭 ☒ jinno@etech.engg.nagoya-u.ac.jp
西村 真弓 ☒ nishimura@etech.engg.nagoya-u.ac.jp

